

# 真空コントローラーつき溶媒回収型 ダイヤフラム真空ポンプシステム LABOPORT® SC 820 G



## 特長

- 沸点を自動的かつ正確にモニタリング
- 溶媒ライブラリ不要
- 低沸点溶媒に対する高い回収率
- リモートコントローラーによりドラフトチャンバ一外から安全な操作可能
- タッチスクリーンディスプレイを採用し簡単に操作可能
- 4つの運転モードを選択(減圧・自動運転・圧力調整・プログラム)
- 10~20L/minの範囲で流量の調整可能
- 高温ガスに有効なガスバラストを搭載
- ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠(内部雰囲気のみ II 3/-G Ex h II B+H2 T3 Gc)

## 推奨アプリケーション

- エバポレータ・デシケーター/乾燥・脱気/脱泡・ろ過

## 製品仕様

排気速度[m <sup>3</sup> /h] @大気圧時	1,2
排気速度[L/min] @大気圧時	20
到達真空度[mbar abs.]	6,0
加圧圧力[bar]	0,1
電圧[V]	100-240
周波数[Hz]	50/60
保護等級	IP30
消費電力[W]	60
消費電流[A]	0,35 (240 V AC) 0,66 (100 V AC)
サーマルスイッチ、ヒューズ内蔵	

## 真空コントロールユニット/コントローラー

入力タイプ	USB-A (Bluetooth) USB-Mini/USB-C (ケーブル接続)
コントローラーの電源	内臓バッテリーまたは 付属のワイヤレス充電を 使用
バッテリー耐久時間	最大8時間
操作方法	タッチパネル ボタン操作
重量 (kg)	コントローラー : 0.69 ドッキングステーション: 0.26
バッテリー	ニッケルメタルハイブリッド (Ni/Mh)

## 材質

ポンプヘッド	TFM™ PTFE
ダイヤフラム	PTFE コーティング
バルブ	FFKM

## その他の仕様

重量 (kg)	13.35
ホースコネクタ	吸入口: 内径8~9.5mmのホースに適合 排気口: 内径10mmのホースに適合
寸法 (mm)	真空ポンプシステム : 347 x 416 x 260 コントローラー : 162 x 96 x 51 ドッキングステーション: 96 x 88 x 101
対応可能ガス・環境温度 (°C)	+5 ~ +40

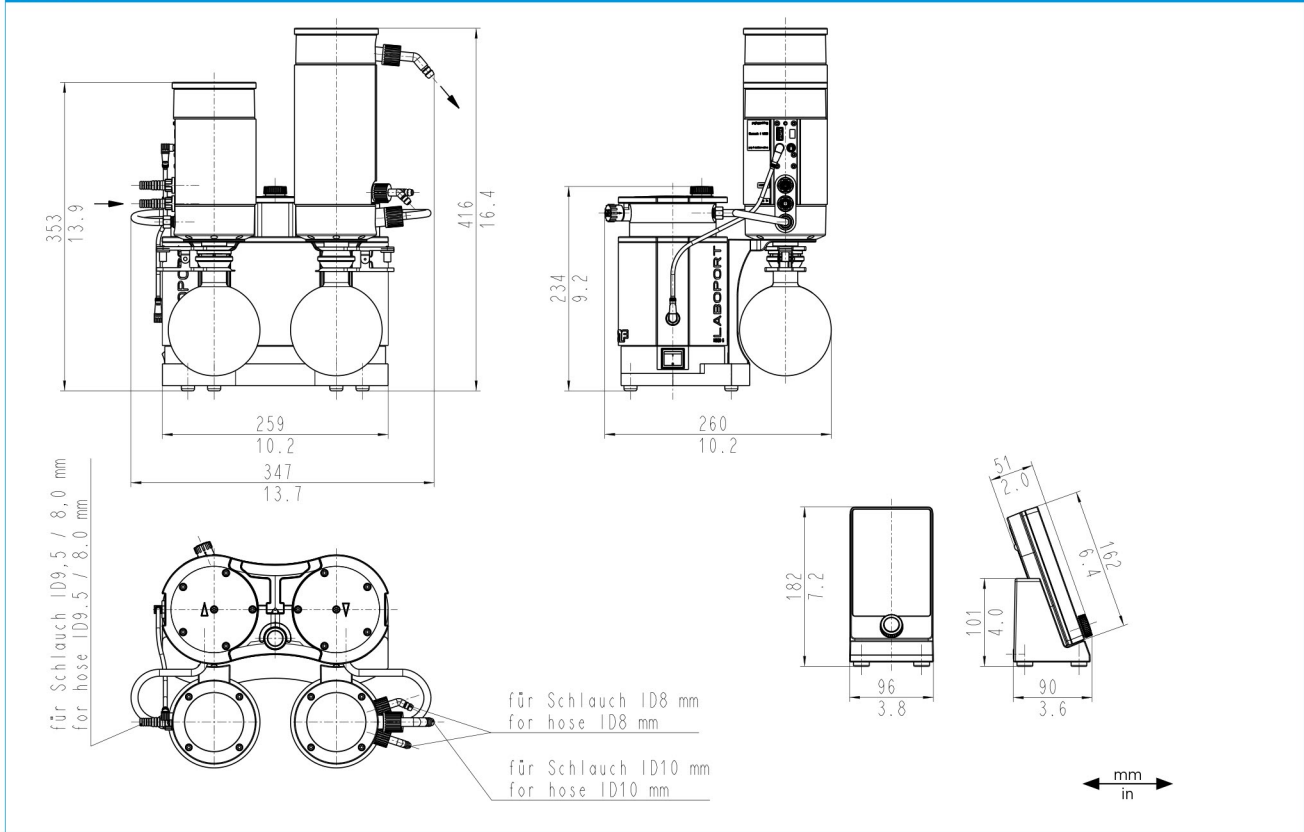
## スペアパーツ

スペアパーツ	ID
N820G用スペアパーツキット	331051
システム用サービスキット*	338823

\*331051のセット内容に加えてOリングが入ったシステム用のサービスキットです

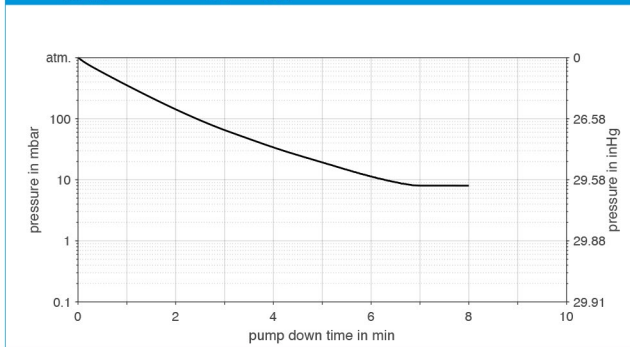
## 図面

### SC 820 G

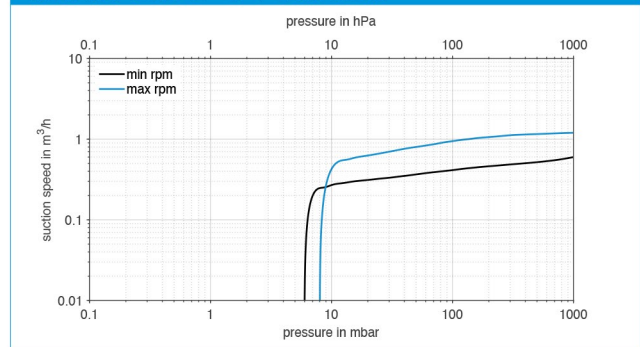


## 真空特性

### 20L 容器における減圧時間



### 最大/最小運転時における排気速度



### アクセサリ

アクセサリ	ID
セパレータフラスコ	047729
リークバルブ付き高性能コンデンサー	114855
ホースコネクタ+Oリング (FKM)	323609
ホースコネクタ PP (内径10mmのホースに適合)	026237
スクリーキャップ(赤) GL18 (ID : 026237のホースコネクタ用)	025980
ホースコネクタ PP (内径8mmのホースに適合)	025981

スクリーキャップ(赤) GL14 (ID : 025981のホースコネクタ用)	025982
ホースコネクタ用ジグ	316279
セパレータフラスコ用BGRホース (SC820 G用 x 1)	329998
高性能コンデンサー用BGRホース (SC820G用 x1)	317157
ドッキングステーション	336784
コントローラ用バッテリー	339004